

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成21年1月29日(2009.1.29)

【公表番号】特表2008-524450(P2008-524450A)

【公表日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【年通号数】公開・登録公報2008-027

【出願番号】特願2007-548264(P2007-548264)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/48 (2006.01)

H 0 1 L 21/316 (2006.01)

H 0 1 M 8/02 (2006.01)

H 0 1 M 8/12 (2006.01)

H 0 1 M 8/14 (2006.01)

H 0 1 M 4/86 (2006.01)

【 F I 】

C 2 3 C 16/48

H 0 1 L 21/316 B

H 0 1 M 8/02 T

H 0 1 M 8/02 K

H 0 1 M 8/02 B

H 0 1 M 8/02 S

H 0 1 M 8/12

H 0 1 M 8/14

H 0 1 M 4/86 T

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月5日(2008.12.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板をコーティングする方法であって：

反応物流れにおいて照射ビームを指向することによって、流れる反応物流れを反応させて、前記照射ビームから下流で生成物流れを生成し、ここで、反応は、前記照射ビームからの光子エネルギーによって駆動されることと；

前記流れ中で選択的に位置決めされた基板において前記生成物流れを指向して、十分に緻密化したコーティング材料の密度の少なくとも約 65% の密度で、前記生成物流れからのコーティング材料で前記基板をコーティングすることと；を含む方法。

【請求項 2】

前記反応物流れは、複数の金属/メタロイド種を有する化合物を含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記反応物流れは、遮蔽ガス内部に制限される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記生成物流れを前記基板において指向する間、前記基板は前記生成物流れの流れに対して移動される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

反応物ノズル及び対応する光学素子は駆動装置表面にのせられ、前記生成物流れは、前記反応物ノズル及び光学素子を移動させることによって前記基板に対して迅速に通過される、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記コーティング材料の前記密度は、前記十分に緻密化したコーティング材料の前記密度の少なくとも約 90 % である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 7】

前記コーティング材料は無孔質である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 8】

前記コーティング材料は結晶性である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 9】

基板をコーティングする方法であって：

生成物流れの流れを適切に位置決めされた基板に指向して前記基板表面のコーティングを堆積することによって、無孔質コーティングを堆積させ、ここで、前記生成物流れは、反応物流れを流れ内部で反応させて前記生成物流れを形成することによって形成され、反応は、照射ビームから吸収された光子エネルギーを用いて駆動されること；を含む方法。

【請求項 10】

基板をコーティングする方法であって：

コーティング材料を堆積して、十分に緻密化したコーティング材料の密度の少なくとも約 65 % の密度を有するコーティングを形成し、ここで、該コーティングは、反応器中で生成物組成物から堆積し、該生成物組成物は、反応物流れを反応させることによって形成される生成物流れ内部にあり、反応は、照射ビームから吸収された光子エネルギーを用いて駆動され、前記コーティングの堆積は、前記生成物流れを前記基板に対して移動させることを含むこと；を含む方法。